

Винахід відноситься до оптики і призначений для оптичного формування мікрорельєфу поверхні виробів мікроелектронної та оптоелектронної техніки створення голографічних елементів, нанесення маркерних знаків та в системах запису інформації.

Завданням винаходу є зменшення тривалості формування мікрорельєфу на поверхні плівки складу As_xSe_{100-x} , де $0 < x < 40$.

Спосіб включає локальне дискретне опромінення поверхні плівки оптично модульованим лазерним променем із області краю поглинання світла матеріалом плівки, під час опромінення температуру плівки підтримують в межах від $0,7 T_g$ до $0,9 T_g$, де T_g - температура розм'якшення матеріалу плівки.